

晶圓玻璃基板 表面檢查機



定位精度
10um

檢測精度
3.5um

最小檢出
10x10um

更多產品

印刷電路板檢測系列、平面顯示器檢測系列、半導體檢測系列
隱形眼鏡檢測系列、鋰電池檢測系列

翔緯光電股份有限公司

TEL : 02-2668-7335 FAX : 02-2668-4322

E-MAIL : service@wisforce.com.tw

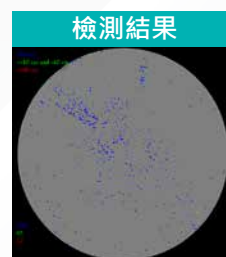
ADD : 238 新北市樹林區佳園路二段59-6號



www.shyawei.com.tw



晶圓玻璃基板 表面檢查機



伺服馬達軸搭配光學尺，其往復定位精度於 $\pm 10\mu\text{m}$ ，提供光學模組精準定位。



Wafer治具使用多孔真空吸附，可將Wafer平整吸附，提升定位精度需求。

檢測樣品	樣品樣式	晶圓玻璃基板
	尺寸範圍	8 " ~ 12" wafer
	精度需求	最小檢出尺寸 $10 \times 10 \mu\text{m}$
	檢測項目	外觀缺陷檢查(外物沾黏、髒污、龜裂、刮傷... 等等外觀缺陷。)
光學規格	檢測方式	Area scan
	相機畫素	5M
	檢測精度	$3.5 \mu\text{m}$
設備規格	設備尺寸	2500(長) \times 1800(寬) \times 2200(高)
	進料方式	Cassette 進料；Robot傳送
	出料方式	Cassette 進料；Robot傳送
	Tact time	200 sec/sheet (12")
	操作模式	Auto
	控制方式	PC
	電源規格	單相 / AC 220V / 60Hz
	氣壓規格	正壓：0.5~0.6MPa